

# Syllabus

開講年度	開講学部等			
2022	共通教育			
開講学期	曜日時限	授業区分	AL(アクティブ・ラーニング)ポイント	YFL育成プログラム
後期集中	集中	講義	5.6ポイント	
時間割番号	科目名[英文名]			単位数
1002220002	知財展開科目 [商標法] [Intellectual Property Development Subject]			1
担当教員[ローマ字表記]				
KUCHKOROV MIRSHOD [KUCHKOROV MIRSHOD]				
授業科目区分		対象学生	平成25年度～令和2年度入学者	対象年次
				～

## 持続可能な開発目標 (SDGs)



※この科目は、学部生向けに開講しています。  
同時に山口大学知的財産教育プログラム(履修証明プログラム)として提供される科目(1単位15時間以上)です。  
履修証明プログラムにおいても科目の修得基準は60点以上です。  
また、本科目では教員、学生間が双方向で議論する授業を行います。  
開講日時は決定次第お知らせいたします。  
※二日間の集中講義<吉田キャンパス>  
2022年11月19、20日共に9:00～16:20開講予定。

## 開設科目名(英訳)

商標法[Trademark Law]

## 使用言語

日本語

## 概要(共通教育の場合は平易な授業案内)

知的財産制度の全体像を解説するとともに、企業における知的財産権の創造、保護及び活用のプロセスを解説する。商標制度とは、マークに関する特別法である。この授業では、この商標法を取扱い、商標制度に関しての法律の理解を基礎とし、商標権の権利の発生から一連の権利取得と消滅までの権利の一生の解説を行う。さらに、この他に、侵害に対する攻防及びその予防策についても開設する。グローバル化に伴いパリ条約、マドリッドプロトコルの条約の解説を行い、国内の商標法の位置づけの明確化を図る。

## 一般目標

1. 商標制度に関わる法制度を理解する。
2. 商標法の意義とその趣旨を理解する。
3. 商標制度について事例や演習を取扱いながら、グローバル化を視野に入れた実践的な能力の育成を目指す。

## 授業の到達目標

知識・理解の観点	<ul style="list-style-type: none"> <li>・商標制度の観点から知的財産を把握し、事業戦略遂行あるいは知財マネジメント(創造・保護・活用)の各局面について説明できる。</li> <li>・知的財産の権利の発生から消滅までについて商標制度の観点から説明できる。</li> <li>・事業戦略の観点から商標制度について理解できる。</li> </ul>
思考・判断の観点	<ul style="list-style-type: none"> <li>・商標制度について、各局面の事実関係に対応する権利を客観的に把握することができる。</li> <li>・商標制度の観点から、商標に該当する否かが判断できる。</li> <li>・商標制度の観点から、商標権の権利範囲を把握することができる。</li> </ul>
関心・意欲の観点	<ul style="list-style-type: none"> <li>・商標制度の客体に関心をもつことができる。</li> <li>・商標の権利化および実務上の管理に関心を持つことができる。</li> <li>・商標制度を活用し、初歩的な個別事業戦略立案に取り組むことができる。</li> </ul>
態度の観点	<ul style="list-style-type: none"> <li>・商標制度を積極的に理解し、権利化を推進することができる。</li> <li>・商標法の客体把握に自立的な取り組みができる。</li> <li>・商標の権利化および管理について、入門レベルの処理ができる。</li> <li>・初歩的な個別事業戦略立案において、商標制度の観点を含めた総合的かつ最適化された企画を行うことができる。</li> </ul>
技能・表現の観点	<ul style="list-style-type: none"> <li>・与えられた課題に沿って、商標法の客体を把握することができる。</li> <li>・マークについて、入門レベルで権利化へのアプローチを検討することができる。</li> <li>・個別事業戦略を立案において、商標制度を活用して効果的な提案をすることができる。</li> </ul>

## 授業計画

本科目では、商標法における様々な制度の解説を行うとともに、商標法に関する条約などの国際的な条約に関しての理解を深める。商標制度を切り口に事業戦略に組み込む方法を解説する。

【週単位】

※AL(アクティブ・ラーニング)欄に関する注

①A～Fのアルファベットは、以下の学修形態を指しています。

【A:グループワーク】、【B:ディスカッション・ディベート】、【C:フィールドワーク(実験・実習、演習を含む)】、【D:プレゼンテーション】、【E:振り返り】、【F:宿題】

②【多】、【中】、【少】は授業時間内におけるALが占める時間の割合を指しています。

【多】:授業時間の50%超、【中】:授業時間の15%～50%、【少】:授業時間の15%未満。「振り返り」と「宿題」については該当する場合に【あり】と表示されます。

項目	内容	授業外指示	授業記録	※						
				A	B	C	D	E	F	
第1週	講義概要(ガイダンス) 知的財産制度の概要	講義の進め方や評価方法などについて説明する。さらに、数多く存在する知的財産の全体像を俯瞰するとともに、それらを三類型化して権利取得や保護活用の基本についての概要解説を行う。	商標制度の意義や商標の役割等について考えを準備してきてもらう。	【少】(授業時間の15%未満)		【中】(授業時間の15%～50%)	【少】(授業時間の15%未満)			
第2週	商標制度①	商標制度の趣旨、主体、客体について解説を行う。	小レポートやワークシートを書いてもらう。	【少】(授業時間の15%未満)	【少】(授業時間の15%未満)	【中】(授業時間の15%～50%)	【少】(授業時間の15%未満)	【あり】		
第3週	商標制度②	商標の客体の解説を行う。さらに商標の類似について演習・解説を行う。	小レポートやワークシートを書いてもらう。	【少】(授業時間の15%未満)	【少】(授業時間の15%未満)	【中】(授業時間の15%～50%)	【少】(授業時間の15%未満)	【あり】		
第4週	商標制度③	商標権取得までの手続き、効力、制限及び権利の変動について概説を行う。	小レポートやワークシートを書いてもらう。	【少】(授業時間の15%未満)	【少】(授業時間の15%未満)	【中】(授業時間の15%～50%)	【少】(授業時間の15%未満)	【あり】		
第5週	商標制度①(マドリッド制度と権利取得までの手続き)	マドリッド制度のマドリッド議定書の解説を行い、商標権取得までの手続きについて解説を行う。さらに、演習とその解説を行う。	小レポートやワークシートを書いてもらう。	【少】(授業時間の15%未満)	【少】(授業時間の15%未満)	【中】(授業時間の15%～50%)	【少】(授業時間の15%未満)	【あり】		
第6週	商標制度と条約	パリ条約の解説を行う。さらに、侵害を発見した場合と侵害に関する警告への対処方法の演習を行う。演習では、(1)侵害を発見した場合の対応方法、(2)侵害に関する警告への対処方法及び(3)侵害の警告を受けないための予防方法について取り上げる。	小レポートやワークシートを書いてもらう。	【少】(授業時間の15%未満)	【少】(授業時間の15%未満)	【中】(授業時間の15%～50%)	【少】(授業時間の15%未満)	【あり】		
第7週	まとめ	これまでの授業で取り扱った内容のまとめを行う。	小レポートやワークシートを書いてもらう。	【少】(授業時間の15%未満)	【少】(授業時間の15%未満)	【中】(授業時間の15%～50%)	【少】(授業時間の15%未満)	【あり】		
第8週	振り返り・期末試験	授業で取り扱った内容をもとに、商標制度について試験を行う。	期末試験を行って、授業全体についての感想文を書いてもらう。	【少】(授業時間の15%未満)	【少】(授業時間の15%未満)	【少】(授業時間の15%未満)	【少】(授業時間の15%未満)	【あり】		

5.6ポイント

成績評価法

授業内レポートや課題、授業態度・授業への参加度、出席等を総合的に評価する。

	知識・理解	思考・判断	関心・意欲	態度	技能・表現	その他	評価割合(%)	JABEE収集資料
定期試験(中間・期末試験)	◎	◎	---	---	---	---	50%	---
小テスト・授業内レポート	---	◎	◎	---	◎	---	40%	---
宿題・授業外レポート	---	---	---	---	---	---	---	---
授業態度・授業への参加度	---	---	---	---	◎	---	10%	---
受講者の発表(プレゼン)・授業内での制作作品	---	---	---	---	---	---	---	---
演習	---	---	---	---	---	---	評価に加えず	---
出席	---	---	---	---	---	---	欠格条件	---
その他	---	---	---	---	---	---	評価に加えず	---

ルーブリック等の評価基準	ファイル名	備考
	設定されていません。	

(注)ルーブリックとは、評価水準である「尺度」と、尺度を満たした場合の「特徴の記述」で構成される評価指標のことを言います。

## 教科書にかかわる情報

## 教科書その他の情報

## 参考書にかかわる情報

参考書	書名	<a href="#">知的財産法入門(第16版)</a>			ISBN	978-4502293313
	著者名	土肥一史	出版社	中央経済社	出版年	2019
参考書	書名	<a href="#">知的財産法概説(第5版)</a>			ISBN	978-4335355547
	著者名	相澤英孝 編著・西村あさひ法律事務所 編著	出版社	弘文堂	出版年	2013
参考書	書名	<a href="#">商標法(第2版)</a>			ISBN	978-4641243118
	著者名	茶園成樹	出版社	有斐閣	出版年	2018

## 参考書その他の情報

## メッセージ

## キーワード

商標権, 知的財産, マーク, 商号, 商標権侵害, 商標評価, マドリッド制度

## 持続可能な開発目標(SDGs)

SDGs4(教育)すべての人に包摂的かつ公正な質の高い教育を確保し、生涯学習の機会を促進する。

SDGs8(経済成長と雇用)包摂的かつ持続可能な経済成長及びすべての人々の完全かつ生産的な雇用と働きがいのある人間らしい雇用(ディーセント・ワーク)を促進する。

SDGs9(インフラ、産業化、イノベーション)強靱(レジリエント)なインフラ構築、包摂的かつ持続可能な産業化の促進及びイノベーションの推進を図る。

SDGs16(平和)持続可能な開発のための平和で包摂的な社会を促進し、すべての人々に司法へのアクセスを提供し、あらゆるレベルにおいて効果的で説明責任のある包摂的な制度を構築する。

SDGs17(実施手段)持続可能な開発のための実施手段を強化し、グローバル・パートナーシップを活性化する。

## 関連科目

科学技術と社会[学部生のための知財入門](1年次必修)

知的財産情報の取得と活用

意匠法

特許法

不正競争防止法

著作権法)

## 連絡先

miru@yamaguchi-u.ac.jp

## オフィスアワー